

**W. Schäfer,
K. Niederauer**

Halbleiteruntersuchungsverfahren im Rasterelektronenmikroskop – EMK/EBIC und Potentialkontrast

Techniques for Studying Semiconductors in the Scanning Electron Microscope – EMF/EBIC and Voltage Contrast 267

Literatur-Notizen / Literature Reviews 282

K. Friedrich

Versagensverhalten verstärkter thermoplastischer Kunststoffe

Failure Behaviour of Reinforced Thermoplastic Polymers 283

**A. Tekin,
A. Wirth**

The Structure and Mechanical Properties of Fe-Mn-Co and Fe-Mn-Co-Mo Alloys (Part 2)

Gefüge und mechanische Eigenschaften von Fe-Mn-Co- und Fe-Mn-Co-Mo-Legierungen (Teil 2) 301

P. Tate

Pinholing in Copper Water-Piping

Lochfraß in Wasserleitungsrohren aus Kupfer 311

Labortip/Laboratory Tip 314

Mitteilungen/Information 315

Tagungskalender/Meeting Diary 316

Mehr sehen, besser erkennen, schneller prüfen mit Zeiss Stereomikroskopen – auch an großen Objekten



Materialprüfung, Fertigungs- und Endkontrolle.

Zeiss Stereomikroskope bieten die besten Voraussetzungen zum Erkennen von Strukturen, Oberflächen und Materialfehlern.

Optimale Geräte- und Objektpositionierung an Tisch-, Boden- und Schwenkstativen sowie mit speziellen Objektischen. Dadurch wird hohe Flexibilität bei der Untersuchung auch großer Objekte erreicht.

Arbeitsabstände bis 2000 mm ermöglichen bequemes Beobachten und Photographieren. Im Auflicht und Durchlicht, im Hellfeld, Dunkelfeld, polarisiertem Licht und Fluoreszenzlicht.

Fragen Sie uns nach Ihren Möglichkeiten mit Zeiss Stereomikroskopen.

**Zeiss
setzt Maßstäbe
in Optik,
Feinmechanik,
Elektronik**

ZEISS

West Germany

Carl Zeiss
Geschäftsbereich
Mikroskopie
Postfach 1369/1380
D-7082 Oberkochen

info-coupon

Bitte, senden Sie mir weitere Informationen über Zeiss Stereomikroskope

Absender

PMG 685